

**文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム 微細構造解析プラットフォーム
名古屋大学 機器利用料**

2019年10月1日
単位:円

I 1時間あたりの使用料(基本料金)

	装置種類	装置等名称	学 内 者	学 外 者	
				非営利法人	営利法人
1		反応科学超高压走査透過電子顕微鏡システム JEM-1000K RS	2,600	3,600	10,500
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	4,300	12,700
2		高電圧用収差補正開発試験装置(収差補正電子顕微鏡) EM-10000BU	1,100	1,500	5,200
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,800	6,300
3	TEM (透過電子顕微鏡)	高分解能電子状態計測走査透過型電子顕微鏡システム(収差補正電子顕微鏡) JEM-ARM200F Cold	1,100	1,500	5,000
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,800	6,000
4		高分解能透過型電子顕微鏡システム JEM-2100F/HK	700	1,000	4,300
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,200	5,200
5		電子分光電子顕微鏡 JEM-2100M	900	1,300	5,300
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,600	6,400
6		透過電子顕微鏡システム JEM-2100 Plus	600	1,000	2,600
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,200	3,200
7	SEM (走査電子顕微鏡)	走査電子顕微鏡 Quanta200FEG	500	800	4,300
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,000	5,200
8		環境実験用観察装置 MP-66100(走査電子顕微鏡) JSM-6610A	400	600	2,200
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	700	2,800
9	FIB-SEM	直交配置型高速加工観察分析装置(FIB-SEM) MI4000L	1,600	2,200	5,400
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,800	6,500
10		バイオ/無機材料用高速FIB-SEMシステム ETHOS NX5000	1,600	2,200	5,700
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,800	6,900
11	FIB (集束イオンビーム)	集束イオンビーム加工機 FB-2100	1,200	1,700	3,900
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	2,100	4,700
12		イオンビーム試料作製装置 JEM-9320T	800	1,100	2,500
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	1,300	3,100
13	その他 試料加工装置	アルゴンイオン照射試料作成装置 クロスセクションポリッシャー	200	400	800
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	1,000
14		金属イオン照射試料作成装置 PIPS-II	200	400	700
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	800
15		クライオミクロトーム LEICA EM UC7	200	400	600
		(オプション)研究成果非公開使用料	---	500	700

機器使用料は、文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細構造解析PF)」の採択により補助され、軽減されております。
2022年3月31日の事業終了(予定)後は、通常の料金設定となります。

- 1 基本使用料は機器利用1時間あたりの利用料です。
- 2 非公開使用料は、機器利用1時間あたりのオプション料金であり、基本料金に別途加算します。
- 3 利用料金には消費税が含まれています。

II 解析手数料(単位:円):EDX,EELS,EBS,D,ED,CL,Amira,3次元像の構築、解析結果報告書の作成等の場合に、基本料金に別途加算

1時間当たり	6,600
--------	-------

III コンサルティング料(単位:円):非公開利用、立ち合い実験、研究・技術相談等の場合に基本料金に別途加算

3時間未満	66,200
3時間以上~6時間未満	165,500
6時間以上~8時間	264,800